

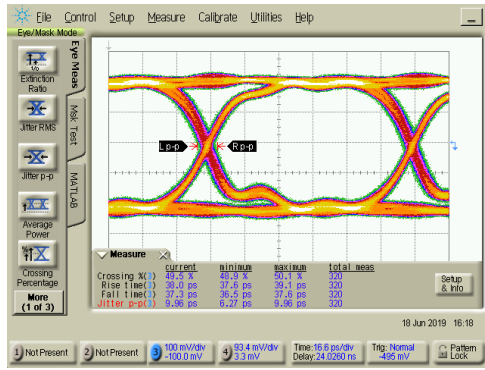
一、 實驗儀器與優化流程

本章會簡單介紹實驗上會用到的關鍵儀器，說明其特性與相關設定，並描述元件使用的優化方式與可能造成誤差之原因。

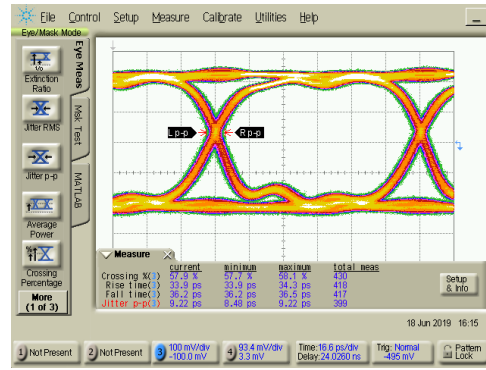
1.1 隨機訊號產生器

由於實驗上無法產生真正的隨機訊號，只能使用偽隨機訊號產生器 (Pseudo Random Bit Sequence, PRBS)，儀器型號為 Anritsu 的 MP1763C，可以產生 0.5 至 12.5 Gb/s 的訊號。偽隨機訊號實際上為週期訊號，會重複出現特定的隨機序列，其週期可以調整，為了達到最接近隨機的效果，我們選擇使用最長的隨機序列，一個週期內共有 $2^{31} - 1$ 的隨機位元。

我們實驗上實際使用的頻率為 10 GHz（或 10 Gb/s），每秒能產生 10×10^9 個隨機位元，以示波器去測量該訊號的眼圖 (eye diagram) 則可以知道訊號的品質，量測結果如圖 1.1，可見實際訊號與理論?? 有很大的差異，實際的訊號有著相對大的上升與下降時間，圖形上下也不太對稱，這都會影響到展頻與壓縮的效果，造成實驗與理論的誤差。



(a) 第一台 EOM



(b) 第二台 EOM

圖 1.1: PRBS 輸出之訊號眼圖 (放大前)

1.2 電光調製器

電光調製器 (Electro-Optic Modulator, EOM) 可使用電訊號對光進行調製，一般而言可以分成三種，分別為振幅、相位與偏振的調製，在我們的實驗中需要調製的是相位。使用的儀器為 EOSPACE 的 SN73717 與 SN73718，分別為頻譜的窄寬與壓縮用。

相位調制器由鈮酸鋰 ($LiNbO_3$) 雙折射晶體製成，因泡克耳斯效應 (Pockels effect)，外加電場能線性的改變快軸上的折射率，進而達到改變相位的效果，且我們稱能將 45 度線偏旋轉至 -45 度的電壓為 V_π 。

由上介紹可知，實際使用上需優化進光的偏振以及電訊號的振幅，以達到預期的相位調製效果。

我們使用半波片 (half-wave plate) 調整入射 EOM 光的偏振方向，若偏振方向不對的話調製效果會不佳，為優化偏振，實驗上會看著調製後的頻譜旋轉半波片，當結果與理論模擬最接近時即為最佳之偏振角度。

1.3 高頻電訊號放大器

由於我們使用的隨機訊號產生器僅能輸出 0.2 至 $2 V_{pp}$ 的訊號，EOM 的 V_π 高於 2 V，需再經過放大器才能提供足夠的電壓去進行相位調製。同樣的，也用示波器去測量眼圖，看放大後的訊號品質，如

圖 1.2，可明顯看出訊號變得更不穩定，且兩台 EOM 使用的電訊號形狀也不同，這是由兩邊使用的 SMA 線的材質與長度均不同，會有不一樣的頻率響應與耗損，使兩個訊號無法互補，這會對頻譜壓縮與還原的效果造成負面的影響。

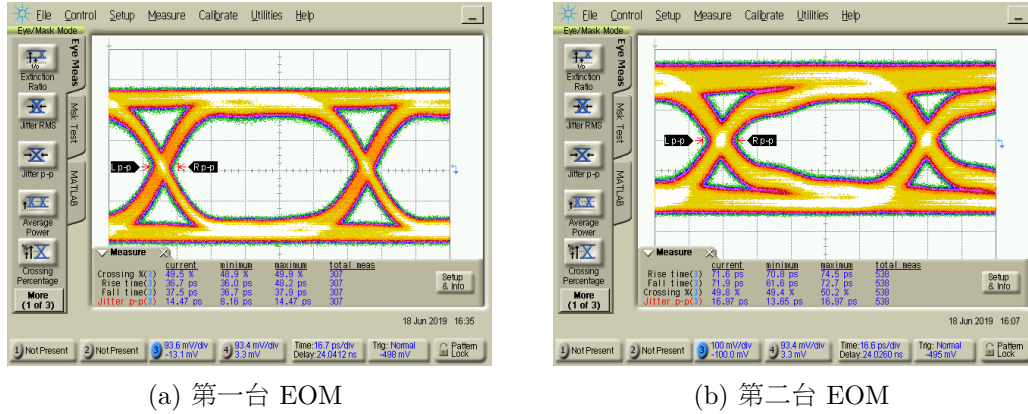


圖 1.2: PRBS 輸出之訊號眼圖（放大後）

1.4 法布立－培若干涉儀

雷射光的頻譜可以用掃描式法布立－培若干涉儀（Scanning Fabry-Perot Interferometer）掃出，我們使用的儀器為 SA210-5B (THOR-LABS)，FSR 為 10 GHz。此干涉儀的主體為一個共振腔，由兩個高反射率的凹面鏡所組成。當光正向入射腔體時，須滿足式 (1.1) 之共振條件的光才會產生建設性干涉，而能透射共振腔。

$$2nL = m\lambda \quad (1.1)$$

n 為共振腔的折射率， L 為腔長，頻率與透射率的關係圖，其中 ν_F 稱為 FSR (Free Spectral Range)，定義如式 (1.2)，此參數決定了這個干涉儀適用的掃頻範圍，調整腔長 L 的大小能改變允許透射的頻率，所以若在其中一面鏡子黏上 Piezo，輸入電壓即可微調腔長，改變允許出光的頻率，達到掃頻的效果。

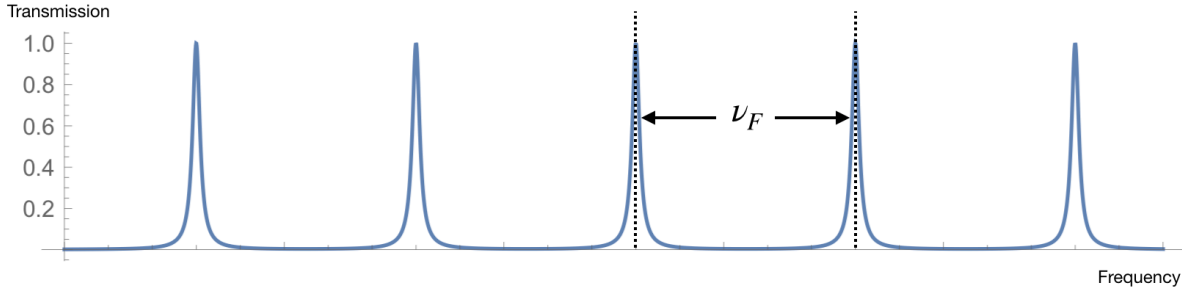


圖 1.3: Fabry-Perot 干涉儀透射頻率

$$\nu_F = \frac{c}{4nd} \text{ (for confocal Fabry - Perot cavity)} \quad (1.2)$$

此外，另一個重要的參數為精細度 F (Finesse)，定義如式 (1.3)：

$$F = \frac{\pi R^{1/2}}{1 - R} \quad (1.3)$$

此共振腔的頻寬（解析度） $\delta\lambda$ 與 F 成反比，關係如式 (1.4)，所以鏡面反射率越高， F 越大，解析度越好，此次實驗使用的干涉儀解析度約為 60 MHz。

$$\delta\lambda = \frac{\nu_F}{F} \quad (1.4)$$

1.5 Etalon 干涉儀

與 Fabry-Perot 干涉儀為相同的原理，但 Fabry-Perot 干涉儀的共振腔體為自由空間 (free space)，而 Etalon 干涉儀的共振腔體則為一塊雙折射晶體，我們可以用 TEC 和溫控器，精準的調控晶體溫度 T 改變腔長 $L(T)$ ，只讓特定中心頻率 ν 附近的光通過。我們實驗使用的型號為 AF023G (MICRO OPTICS, INC.)，頻寬為 60 MHz，FSR 為 13.6 GHz。

由於腔體是由雙折射晶體製成，所以不同的偏振在內部會有不一樣的行進速度，而會產生兩組不同的模態，所以在實驗優化上，需要將入

射 Etalon 干涉儀的光調成與晶軸方向相同的線偏光，才能最有效率的使用濾波器。